

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】平成 25 年 2 月 14 日 (2013.2.14)

【公開番号】特開 2010-190887 (P2010-190887A)
【公開日】平成 22 年 9 月 2 日 (2010.9.2)
【年通号数】公開・登録公報 2010-035
【出願番号】特願 2009-288818 (P2009-288818)
【国際特許分類】

G 0 1 N 21/35 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/35 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 12 月 19 日 (2012.12.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

テラヘルツ波を用いて物体を分析するための分析装置であって、
テラヘルツ波を発生させる発生部と、
テラヘルツ波を検出する検出部と、
前記発生部から発生したテラヘルツ波を前記物体における第 1 の位置に集光させる第 1 の光学部と、
前記物体からのテラヘルツ波を前記検出部の検出面に集光させる選択部と、を備え、
前記選択部は、前記物体からのテラヘルツ波を第 2 の位置に集光させる第 2 の光学部と
、前記第 2 の位置に集光したテラヘルツ波を前記検出面上の第 3 の位置に集光させる第 3 の光学部と、を有し、
前記選択部は、前記第 1 の光学部よりも多くの焦点を持つことを特徴とする分析装置。

【請求項 2】

前記検出部は、光伝導膜と、互いに間隙を有して該光伝導膜に設けられる電極対と、を有する光伝導素子であり、

前記第 2 の位置は、前記間隙で、且つ前記電極対が設けられる前記光伝導膜における面にあるように構成されることを特徴とする請求項 1 に記載の分析装置。

【請求項 3】

テラヘルツ時間領域分光法により、前記検出部で検出したテラヘルツ波を用いて、前記物体における前記第 1 の位置で反射したテラヘルツ波の時間波形を取得する時間波形取得部を備えることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の分析装置。

【請求項 4】

前記検出部が前記テラヘルツ波を検出するタイミングを変更する遅延光学部と、
前記時間波形の時間領域に応じて前記遅延光学部を制御する制御部と、を備え、
前記時間領域は、前記検出部で検出されるテラヘルツ波の強度に応じて設定されることを特徴とする請求項 3 に記載の分析装置。

【請求項 5】

前記第 3 の光学部と前記検出部との間に配置される開口部を備え、
前記開口部は、前記物体からのテラヘルツ波のうち、前記物体における前記第 3 の位置に集光するテラヘルツ波を選択的に透過するように配置されることを特徴とする請求項 1

乃至 4 のいずれか 1 項に記載の分析装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明に係る分析装置は、テラヘルツ波を用いて物体を分析するための分析装置であって、テラヘルツ波を発生させる発生部と、テラヘルツ波を検出する検出部と、前記発生部から発生したテラヘルツ波を前記物体における第 1 の位置に集光させる第 1 の光学部と、前記物体からのテラヘルツ波を前記検出部の検出面に集光させる選択部と、を備え、前記選択部は、前記物体からのテラヘルツ波を第 2 の位置に集光させる第 2 の光学部と、前記第 2 の位置に集光したテラヘルツ波を前記検出面上の第 3 の位置に集光させる第 3 の光学部と、を有し、前記選択部は、前記第 1 の光学部よりも多くの焦点を持つことを特徴とする。